

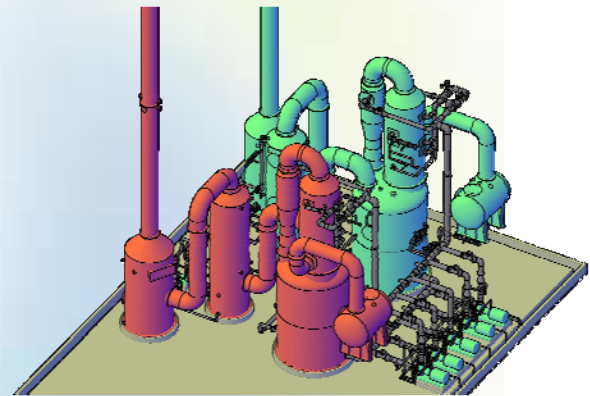
## 多晶硅工艺排气洗涤系统

中国江西某一多晶硅厂寻求一种安全高效的方案，来洗涤工艺排气中的氯硅烷和HCl气体。废气中除了氯硅烷气体，还含有大量的H<sub>2</sub>。

维朗帝斯提供的方案为3套2段式洗涤系统。2段式洗涤系统由2段平行的洗涤装置组成，一用一备（见右图），包括气液分离罐、喷淋塔、文丘里喷射塔、填料塔、液封罐、排气筒和控制盘。

一用一备的形式使得洗涤塔在维护时能自动切换，不影响前方工艺生产。维朗帝斯的设计使得洗涤塔系统能有很高的去除效率，并且也使废水量最小化以降低后续的处理成本。

维朗帝斯能按照废气流量，污染物浓度和去除效率为客户提供度身定制的处理方案。我们为亚洲、欧洲、北美等众多多晶硅厂提供过多套工艺/紧急排气洗涤系统，焚烧炉后端的废气处理系统。



应用	氯硅烷和HCl洗涤
排气量	7,650 m <sup>3</sup> /h
温度	40 °C
压强	13.8 KPa
污染物质	HCl, SiCl <sub>4</sub> , HSiCl <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> SiCl <sub>2</sub>
净化率	99.999%
洗涤溶液	NaOH
设备材质	FRP